

# LODAS-mini

これまでの検査装置は時間がかかりすぎ！

**検査速度を速くしたい**

**最短 120 秒**

目視検査の見落としが心配な方！

**目視検査から解放されたい**

**表面・内部・裏面  
同時検査**

顕微鏡では検査漏れが多い！

**検査精度を良くしたい**

**高感度  
: 0.1  $\mu$ mPSL**

検査対象：

**Photomask**  
**SiC**  
**Silicon Wafer**

